

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE GARE, CONTRATTI E LOGISTICA

Servizio Gare/GT/GA



Direzione Gare, Contratti e Logistica La Dirigente

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università";

Visto lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.49150 del 22 dicembre 2015;

Vista: la disposizione del Direttore Generale prot. n. 9961 del 28/02/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente della Direzione Gare Contratti e Logistica alla Dott.ssa Elena Perini e la disposizione del Direttore Generale prot. n. 19503 del 19/04/2017 che ha disposto l'operatività, dal 20 aprile 2017, della Direzione in parola competente per le procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa n. 177 del 10 giugno 2016, sulla quale ha espresso parere favorevole il Senato Accademico dell'Università di Pisa con delibera n.111 del 22 giugno 2016, con la quale è stato stabilito che, nelle more della revisione del Titolo VIII "Attività negoziale" del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le disposizioni di cui al predetto Titolo VIII del vigente Regolamento e le relative disposizioni attuative continuano ad essere applicate se non in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

Visto l'art. 54, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi del quale, <<con esclusione dei contratti di cui al comma precedente deliberati dal Consiglio di Amministrazione>>, la deliberazione a contrattare <<è adottata dai Responsabili dei Centri di gestione nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi centrali di governo e dai relativi consigli anche in sede di approvazione dei bilanci di previsione annuale.....>>.

Visto il proprio provvedimento prot.41295 del 03.07.2018, dal quale, tra l'altro, risulta quanto segue:

- l'approvazione della relazione del RUP e della Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica allegati al provvedimento stesso sub.1;
- l'approvazione dell'elenco ditte da invitare alla procedura negoziata per la fornitura di **"RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)"** così come risultante dall'allegatosub.1 al predetto provvedimento n.41295;

Vista la delibera a contrattare protocollo n.41913 del 05 luglio 2018, con la quale è stato autorizzato l'esperienza della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sul sistema START per l'affidamento della fornitura **“RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)”** per un importo a base di gara di Euro 82.000,00 oltre I.v.a. di cui costi per la manodopera per la posa in opera pari ad Euro 250,00 oltre I.v.a. compresi nell'importo stimato, ed è stato approvato il Progetto ai sensi dell'art.23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti comprensivo dei seguenti documenti: lettera di invito, relazione tecnico illustrativa, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto mediante scambio di lettere, disciplinare di gara e schede allegate (DGUE, scheda dichiarazioni integrative, scheda consorziata, schede di avvalimento art.89 e art.110, scheda offerta tecnica);

Visto che con lettera protocollo n.42001 del 05 luglio 2018 sono state invitate 2M STRUMENTI S.r.l. e MITEC S.r.l. a presentare offerta,

Visto che la società 2M STRUMENTI S.r.l. ha presentato offerta entro i termini prescritti nella lettera di invito;

Visto che nella seduta pubblica del 27 luglio 2018 la Commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare la fornitura, installazione e posa in opera dell'attrezzatura **“RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)”** per un importo di Euro 78.720,00 (I.v.a. esclusa) alla società 2M STRUMENTI S.r.l. con sede a Roma (RM) in Via G. Pontano, 9;

Visto il provvedimento della sottoscritta n.48104 del 30 luglio 2018 con il quale è stato disposto di aggiudicare la procedura di gara per l'affidamento della fornitura installazione e posa in opera dell'attrezzatura **“RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)”** per un importo di Euro 78.720,00 (I.v.a. esclusa) alla società 2M STRUMENTI S.r.l. con sede a Roma (RM) in Via G. Pontano, 9;

Visti i documenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché i documenti relativi alla verifica dei requisiti tecnico organizzativi comprovati dalla Società aggiudicataria;

Preso atto che per tale verifica è stato richiesto, tra l'altro, da questa Università alla competente Procura della Repubblica di Pisa rispettivamente con lettera protocollo n.48371 del 30 luglio 2018 e con lettera protocollo n.48381 del 30 luglio 2018:

- il casellario giudiziale ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n.313/2002 per i soggetti che in base a quanto disposto dall'art.80 del D.P.R. n.50/2016 ricoprivano vari incarichi o qualifiche in seno a 2M STRUMENTI S.r.l.;
- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a nome della predetta 2M STRUMENTI S.r.l.;

Vista l'idoneità della documentazione tecnico organizzativa presentata dalla società 2M STRUMENTI S.r.l. la quale ha documentato di aver svolto, così come richiesto, almeno una fornitura analoga per Enti Pubblici o Privati;

Rilevato che dalla verifica della predetta documentazione la società 2M STRUMENTI S.r.l. risulta in possesso di tutti i requisiti richiamati da questa procedura di gara;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, deve essere dichiarata **l'efficacia dell'aggiudicazione** dell'appalto ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016;

Richiamato l'art.32, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 in base al quale il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs. n.50/2016.

DISPONE

Art.1) di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura, installazione e posa in opera dell'attrezzatura **"RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)"** per un importo di Euro 78.720,00 (I.v.a. esclusa) alla società 2M STRUMENTI S.r.l. con sede a Roma (RM) in Via G. Pontano, 9;

Art. 2) di stipulare il contratto nei successivi 60 giorni, o nel diverso termine concordato con l'aggiudicatario, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;

Art. 3) di pubblicare questo provvedimento, sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall' art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Direzione Gare Contratti e Logistica
f.to La dirigente - Dott.ssa Elena Perini
(firmato digitalmente)